PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-218222

(43) Date of publication of application: 27.08.1993

(51)Int.CI.

H01L 23/12 H01L 21/60 H01L 23/14 H01L 23/28

(21)Application number : 04-017487

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

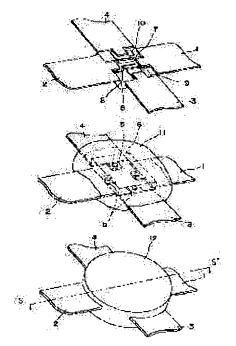
03.02.1992

(72)Inventor: MITANI TATSURO

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE FOR HIGH FREQUENCY USE AND ASSEMBLY **THEREOF**

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a resin-sealed semiconductor device for high frequency use having no dielectric loss by a method wherein a molding resin package is used and a flip-chip system and the form of a hollow package are adopted. CONSTITUTION: Leads 1 to 4 are in a state that they are separated from each other. A bonding is performed by a flip-chip system and bumps 5 are respectively formed on each end part of the leads 1 to 4. Gate, drain and source electrode pads 7 to 10 on a chip 6 are directly bonded to the leads 1 to 4 through the bumps 5. The chip 6 adhered to the leads and the end parts of the leads 1 to 4 on the periphery of the chip are wrapped in the interior of a phenolic novolak epoxy resin 11 with the resin 11. The chip 6 and the end parts of the leads are sealed with a molding resin member 12 in such a way as to cover the epoxy resin. The epoxy resin is absorbed in the member 12 due to heat at the time of the sealing and the member 12 is turned into a hollow package. The reactances of the leads 1 to 4 are reduced by the adoption of the flip-chip system, the chip 6



is not closely adhered to the member 12 by the adoption of the form of the hollow package and a dielectric loss is eliminated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-218222

(43)公開日 平成5年(1993)8月27日

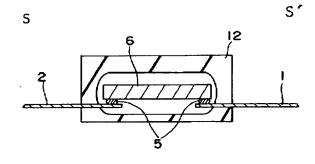
(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L			識別記 301 321	Z	庁内整理番号 8617-4M 6918-4M 8617-4M 8617-4M	F I H O 1 L			技術表示箇所 R 請求項の数 2(全 4 頁)
				J					
				J			23/ 14 審査請求	未請求	
(21)出顯番号		特願平4-17487			(71)出願人	-	000003078 株式会社東芝		
(22)出願日		平成4	年(199	92) 2 F	∄3日	(72)発明者	手 三谷 遠神奈川県	室郎	幸区堀川町72番地 幸区小向東芝町1番地 株 川工場内
					D	(74)代理人	、弁理士	鈴江 立	武彦

(54)【発明の名称】 樹脂封止型髙周波用半導体装置及びその組立て方法

(57)【要約】

【目的】モールド樹脂パッケージを用い、フリップチップ方式、中空パッケージの形態を採用し、高周波特性の 改善を実現することを最も主要な特徴とする。

【構成】リード1,2,3,4がそれぞれ分離されており、端部にバンプ5が形成される。半導体チップ6と上記各リードはフリップチップ方式のボンディングがなされる。エボキシ樹脂11によって、リード1,2,3,4に接着されたチップ6とその周辺の各リード端部を内部に包み込む。このエボキシ樹脂11を覆うようにモールド樹脂部材12により封止される。この封止時の熱により、エボキシ樹脂11がモールド樹脂部材12中に吸収される。これにより、中空のモールドバッケージとなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップと、前記半導体チップ上に 形成された電極パッドと、各々分離され接続端部にバン プが形成された各リード端子と、前記各リード端子のバ ンプと前記半導体チップの電極パッドが各々直接ボンデ ィングされる接続手段と、前記半導体チップ及びリード 端子の接続端周辺の領域が中空となって封止される樹脂 封止部材とを具備したことを特徴とする樹脂封止型高周 波用半導体装置。

れに接続用バンプを形成する工程と、前記半導体チップ 上に形成された電極パッドと前記バンプが各々直接ボン ディングする工程と、前記チップ及びリードの接続端周 辺の部分をエポキシ系の樹脂で包み込む工程と、モール ド樹脂部材により前記エポキシ系の樹脂を覆い封止時の 熱により前記エポキシ系の樹脂をモールド樹脂部材中に 吸収させる工程とを具備したことを特徴とする樹脂封止 型高周波用半導体装置の組立て方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は特にマイクロ波デバイ ス等の樹脂封止型高周波用半導体装置及びその組立て方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】図7は従来の樹脂封止型髙周波用半導体 装置の構成を示す斜視図である。リード21は両端に伸び るソース端子の共通リードである。このリード21上にチ ップ22が固着されている。チップ22上には各電極バッド 23~26が形成されている。ゲートに繋がる電極パッド23 はゲート(入力)端子であるリード27にボンディングワ 30 イヤ28により接続される。ドレインに繋がる電極バッド 24はドレイン(出力)端子であるリード29にボンディン グワイヤ28により接続される。ソースに繋がる電極バッ ド25, 26はソース (接地) 端子である上記リード21にボ ンディングワイヤ28により接続される。

【0003】上記構成のチップ22が破線で示すモールド 樹脂30℃より封止される。すなわち、チップ22及びチッ プ22下のリード21、ボンディングワイヤ28及びリード2 1, 27, 29のボンディングワイヤ28接続部分を含んで緻 密に封止され製品化される。通常、超高周波用半導体装 40 置のパッケージはセラミック・パッケージが一般的であ る。その理由は寄生容量を小さくすることができるから である。

【0004】一方、上記図7に示されるような樹脂によ るパッケージは、セラミック・パッケージに比べて安価 である。とのために、衛生放送等、民生用としての用途 に対してコスト・メリットが期待でき、有望である。

【0005】しかしながら、上記図7に示されるような 樹脂によるパッケージは、チップ22全面にモールド樹脂 30が密着しているので、このモールド樹脂30が持つ固有 50

の誘電率により、デバイスの誘電損失が大きくなってし まうという欠点がある。この誘電損失は扱われる周波数 が髙くなるに従って、髙周波特性を悪化させる。

【0006】ボンディングワイヤ28の長さを短くしてリ ード21,27,29のリアクタンスを低減させ、高周波特性 を改善するという方法もある。しかし、図7の構成のリ ードフレームの形状を考えるとボンディングワイヤ28を 短くするには限界があり、この方法で髙周波特性を改善 するのは困難である。従って、モールド樹脂によるパッ 【請求項2】 各々分離されたリード端子の端部それぞ 10 ケージはコスト・ダウンには有効であるが、髙周波用半 導体装置のバッケージとしては不向きである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来では 髙周波用半導体装置のパッケージとしてモールド樹脂に よるパッケージを採用すると高周波特性の改善が困難で あるという欠点がある。

【0008】この発明は上記のような事情を考慮してな されたものであり、その目的は、髙周波特性の改善が実 現され、安価な樹脂封止型高周波用半導体装置及びその 組立て方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】との発明の樹脂封止型高 周波用半導体装置は、半導体チップと、前記半導体チッ プ上に形成された電極パッドと、各々分離され接続端部 にバンプが形成された各リード端子と、前記各リード端 子のバンプと前記半導体チップの電極パッドが各々直接 ボンディングされる接続手段と、前記半導体チップ及び リード端子の接続端周辺の領域が中空となって封止され る樹脂封止部材とを具備したことを特徴としている。

【0010】との発明の樹脂封止型高周波用半導体装置 の組立て方法は、各々分離されたリード端子の端部それ ぞれに接続用バンプを形成する工程と、前記半導体チッ ブ上に形成された電極バッドと前記バンブが各々直接ボ ンディングする工程と、前記チップ及びリードの接続端 周辺の部分をエポキシ系の樹脂で包み込む工程と、モー ルド樹脂部材により前記エボキシ系の樹脂を覆い封止時 の熱により前記エポキシ系の樹脂をモールド樹脂部材中 に吸収させる工程とを具備したことを特徴としている。 [0011]

【作用】分離されたリード端子は半導体チップとの直接 ボンディングに対し、位置合わせが容易であり高精度を もたらす。また、リード端子と半導体チップとの直接ボ ンディングの構成は半導体チップのボンディング状態を 各リード端子のリアクタンスを低減する。さらに、モー ルド樹脂部材により前記エポキシ系の樹脂を覆い封止時 の熱により前記エポキシ系の樹脂をモールド樹脂部材中 に吸収させて、中空パッケージを構成する。このような 方法を採用して髙周波特性の改善を実現する。

[0012]

【実施例】以下、図面を参照してこの発明を実施例によ

3

り説明する。図1~図6はこの発明の樹脂封止型高周波 用半導体装置の組立て方法を順次示す構成の斜視図である。

【0013】図1はリードフレームの構成を示している。図1に示されるように、リード1、2、3、4 と4 端子それぞれ分離された状態になっている。フリップチップ方式のボンディングがなされるため、リード1、2、3、4 それぞれの端部には例えばAuSnからなるパンプ5 が形成される。

【0014】図2、図3は上記図1の分離された4端子 10 に対し、半導体チップ6 がフリップチップ方式によりボンディングされた状態を示す。なお、図3は図2の構成を裏側からみた斜視図である。

【0015】各バンプ5 により、チップ6 のゲート、ドレイン、ソースの各電極バッド7 ~10 (図3に図示) とリード1,2,3,4 とが直接ボンディングされる。リード1 はゲート (入力) 端子、リード2 はドレイン (出力) 端子、リード3,4 はソース (接地) 端子となる。各バンプ5 と各電極バッドとは300℃前後の加熱で接着される

【0016】各リード1、2、3、4がそれぞれ分離されているので、チップ6がボンディングされる中心部は、リードが抜けた形状となっている(図3)。このようなリード形態はチップ6のボンディング状態を確認することが容易である。よって、フリップチップ方式によるボンディングでも位置合わせが容易で、精度良くできる。

【0017】図4に示されるように、フェノール・ノボラック系のエポキシ樹脂(あるいはワックス)11によって、リードに接着されたチップ6とその周辺の各リード 301,2,3,4 端部を内部に包み込む。

【0018】図5に示されるように、上記エポキシ樹脂 11を覆うようにモールド樹脂部材12により封止する。モ ールド樹脂部材12の封止時の熱により、図4で示すエポ キシ樹脂11がモールド樹脂部材12中に吸収される。これ により、図6の断面図に示されるように、中空のモール ドパッケージとなる。

【0019】上記実施例によれば、第1にフリップチップ方式を採用したことにより、チップ6 と各リード1,*

*2,3,4 とがボンディングワイヤなしに接続可能となる。この構成はリード1,2,3,4 のリアクタンスの 低減に寄与する。従って、高周波特性が改善される。また、ボンディングワイヤでの接続よりも、モールド歪み に対して強度が優れている。

【0020】第2に各リード1,2,3,4 とが分離しているため、フリップチップ方式を採用するにあたり、チップ6と各リード1,2,3,4 とのボンディング位置合わせが容易である。

10 【0021】第3に中空のモールド樹脂パッケージを構成するので、チップ6にモールド樹脂部材12が密着しない。従って、誘電損失がほとんどなく、高周波特性が改善される。しかも、モールド樹脂パッケージはセラミックパッケージよりも格段に安価である。

[0022]

【発明の効果】以上説明したようにこの発明によれば、モールド樹脂パッケージを用い、分離されたリード端子、フリップチップ方式、中空パッケージを採用することにより、高周波特性が改善され、安価で信頼性の高い 樹脂封止型高周波用半導体装置及びその組立て方法が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の組立て方法の構成を示す第1の斜視 図。

【図2】この発明の組立て方法の構成を示す第2の斜視 図。

【図3】図2の構成を裏側からみた斜視図。

【図4】との発明の組立て方法の構成を示す第3の斜視図。

30 【図5】との発明の組立て方法の構成を示す第4の斜視 図。

【図6】図5のS-S′線に沿う断面図。

【図7】従来の樹脂封止型高周波用半導体装置の構成を 示す斜視図。

【符号の説明】

1. 2, 3, 4 …リード、 5…バンブ、 6…半導体チップ、 7, 8, 9, 10…電極バッド、11…エボキシ樹脂、12…モールド樹脂部材。

【図6】

